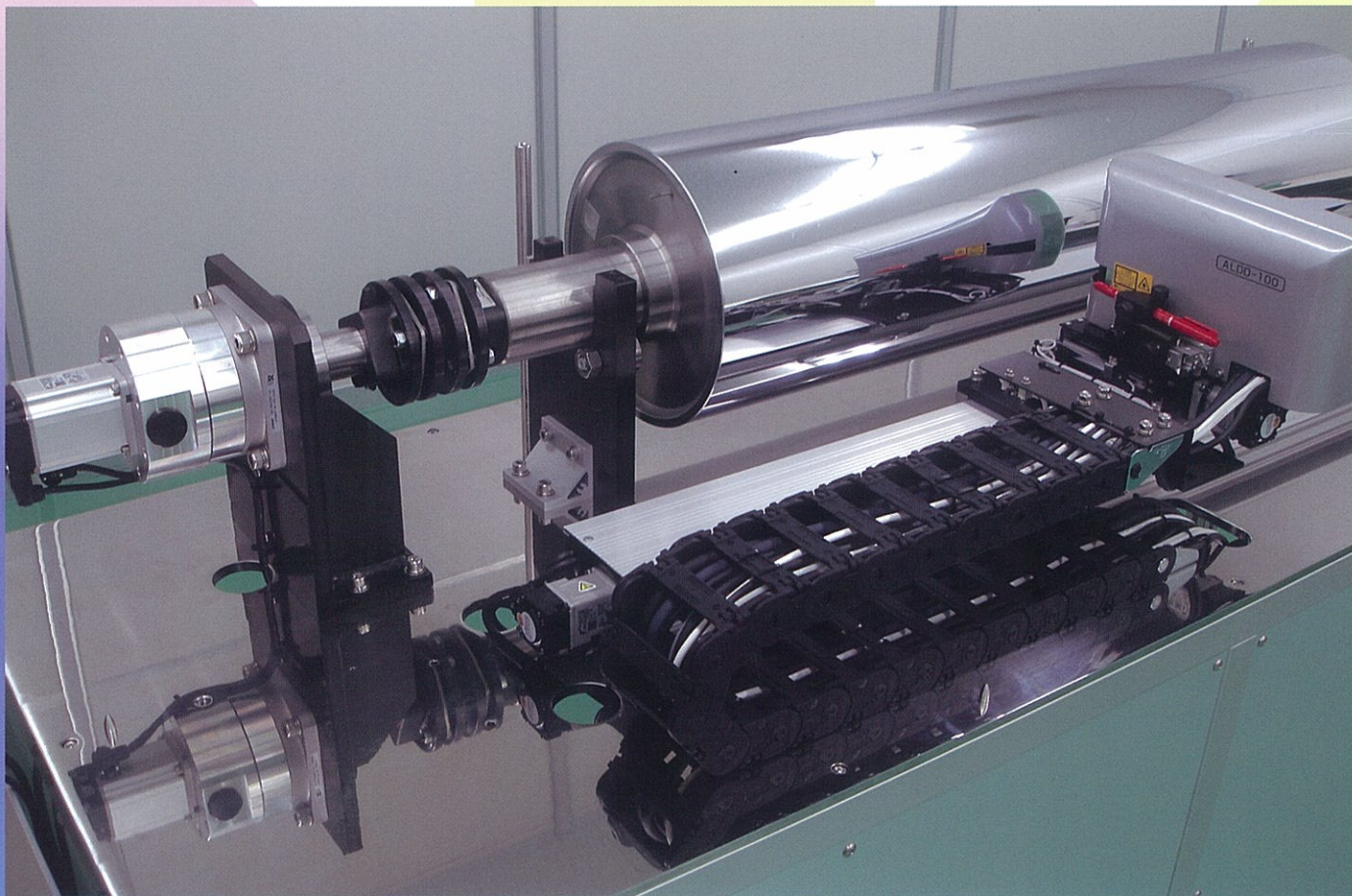


NEW

微小欠陥を検出! 表面欠陥自動検出装置
ミラーマイクロ・P
ALDD

本装置は、レーザー光線と光測定器とからなる検査モジュールをローラ表面に沿って細かいピッチで走らせ、PDP(プラズマディスプレイパネル)、液晶パネル等に使用される高精度フィルム製造用の超鏡面ローラ表面の微小欠陥(数十 μm のキズ、ビット、ピンホール、クラック等)を自動で検出し、微小欠陥位置の記録とマッピングを行い、検出終了後にマッピング位置へ移動し、画像観察、画像記録、マーキングを行う検査装置システムです。



微小欠陥
検出の流れ



微小欠陥の顕微鏡写真



検出した微小欠陥

- ユーザー仕様に合わせた各種カスタマイズ製作可能
- 微小欠陥の定義入力は不要
- 複雑な操作は一切不要
- 微小欠陥を1 m^2 あたり8分程度で自動検出
- 目視検査よりも微細な欠陥を取りこぼしなく検査可能
- マッピング機能で微小欠陥の位置を記録
検出された微小欠陥の位置座標を記録し、マッピングを行います
- 微小欠陥の判定
微小欠陥の検出終了後にマッピングされた微小欠陥の位置へ順次移動し、
CCDカメラで画像観察を行う
画像観察にて欠陥と判定された微小欠陥の画像を記録し、
微小欠陥位置にマーキングを行います

このカタログは、平成21年度ものづくり中小企業製品開発等支援補助金(試作開発等支援事業)により作成しています。